

貸付機械器具一覧

【R3.5.18現在】

機器番号	機器名	料金 (円/時間)
M100	旋盤	510
M102	帯のこ盤	270
M103	小型平面研削盤	850
M106	精密切断機	540
M108	シグ中ぐりフライス盤	660
M111	雰囲気調整電気炉	1,630
M112	高周波誘導電気炉	1,220
M114	高周波誘導式真空溶解炉	2,890
M115	粉末処理装置	140
M116	手動切断機	190
M117	試料埋込機	1,050
M118	自動研磨装置	3,500
M119	精密ワイヤ放電加工機 (B軸無使用)	2,560
M120	精密ワイヤ放電加工機 (B軸使用)	3,410
M121	高速加工機	2,980
M122	CAD/CAMシステム	690
M123	超高温電気炉	270
M124	真空含浸装置	700
M125	精密切断機 (硬質・脆性材料切断)	970
M200	万能試験機	630
M201	精密万能試験機 (250kN)	1,170
M204	内部欠陥判定装置	470
M205	ワックス物性試験機	170
M206	塩乾湿複合サイクル試験機装置	1,700
M207	シャルピー衝撃試験機	240
M209	薄膜硬度計	280
M211	高解像度ハイスピードカメラ	1,390
M212	表面粗さ測定装置	1,730
M214	CNC三次元測定機	4,340
M215	万能形状測定装置	990
M216	サーモグラフィ	910
M218	FFTアナライザ	230
M219	構造解析システム	1,700
M220	3次元湯流れ凝固解析システム	410
M222	測定顕微鏡	830
M223	万能投影機	370
M224	超微小硬さ試験機	540
M225	デジタル金属顕微鏡	610
M226	コンピュータ設計支援システム	490
M227	加工機制御用CAD/CAMシステム	790
M228	高性能マイクロフォーカスX線CTシステム (計測処理)	8,200
M229	非接触3次元デジタイジングシステム	3,750
M230	表面性状測定機	2,580
M231	高倍率型マイクロ스코プ	600
M232	卓上型走査電子顕微鏡	2,250
M233	微細形状観察評価装置 (レーザー顕微鏡)	1,980
M234	高性能マイクロフォーカスX線CTシステム (ポスト処理)	930

P100	サンプルカット用プロッタ	440
P101	3Dプリンタ① (材料持込)	1,060
P102	3Dプリンタ② (0.1270mm)	1,700
P103	3Dプリンタ③ (0.1778mm)	2,180
P104	3Dプリンタ④ (0.2540mm)	2,720

機器番号	機器名	料金 (円/時間)
C100	射出成形機	1,440
C102	精密切断機	920
C103	粉碎機 (ジェットミル)	1,750
C104	マイクロカッティングマシン	540
C200	F T赤外分光光度計	2,680
C201	X線回折装置	3,270
C203	静荷重試験機	1,580
C205	電界放出型走査電子顕微鏡 (分析)	6,930
C206	電界放出型走査電子顕微鏡 (観察)	5,810
C208	熱分析装置	2,060
C209	X線分析顕微鏡	2,100
C211	パウダテスター	260
C212	熱分解ガスクロマトグラフ質量分析装置	4,370
C213	レーザー回折式粒度分布測定器	1,500
C214	混練性・押出し試験装置	3,770
C216	比表面積・細孔分布測定装置	770
C217	X線光電子分光分析装置	4,460
C218	イオンクロマトグラフ (陽イオン)	1,410
C219	イオンクロマトグラフ (陰イオン)	1,380
C220	イオンビームミリング装置 (電子顕微鏡用試料作成装置)	2,090
C221	高周波プラズマ発光分析装置	3,450
C222	低温プラズマ分解装置	520
C223	マイクロサンプリングマシン	960
C225	マイクロ波分解装置	850
C226	誘導結合プラズマ質量分析装置 (ICP-MS)	2,560
C227	紫外可視分光光度計	170
C228	恒温恒湿器 (旧)	140
C229	恒温恒湿器 (新)	160
C230	卓上型pHメーター	450
C231	実体顕微鏡システム	170

W100	丸鋸昇降盤	180
W101	軸傾斜横挽丸鋸盤	210
W102	手押し鉋盤	220
W103	自動鉋盤	370
W104	定温乾燥機	250
W105	ディスクリファイナー	1,150
W106	ホットプレス	360
W107	恒温恒湿器	160

J 100	電磁界解析ツール	720
J 104	微小部X線応力測定装置	710
J 105	三次元磁界ベクトル分布測定装置	160
J 106	真空均温熱処理装置	560
J 200	磁気シールドルーム	11,390
J 201	ヘルムホルツコイル	310
J 202	直流磁化測定装置	1,930
J 203	ソレノイドコイル	470
J 204	校正用機器	160
J 205	ガウスメータ	250
J 206	レーザードップラ振動計	1,630
J 207	パワーアンプ	530
J 208	パワーアナライザ	760

機器番号	機器名	料金 (円/時間)
F101	低温恒温恒湿機	300
F102	クリーンベンチ	200
F103	真空凍結乾燥機	1,320
F104	ドラム乾燥機	870
F105	真空包装機	170
F106	低温高速遠心機	330
F107	プレハブ仕込室	170
F108	高温高圧調理殺菌装置	1,710
F111	細胞破碎装置	210
F112	微生物増殖装置	490
F117	スプレードライヤー	270
F118	高圧ホモジナイザー	350
F119	微細装置	580
F121	ホモジナイザー	160
F122	ロータリーエバポレーター	120
F200	水分活性測定装置	470
F201	測色色差計	380
F203	レオメーター	210
F206	近赤外分析装置	1,680
F207	高速液体クロマトグラフ	1,310
F208	キャピラリーガスクロマトグラフ	660
F211	自記光電分光光度計	420
F212	原子吸光分析装置	760
F213	pHメーター	210
F214	密度比重計	150
F215	蛍光プレートリーダー	810
F216	高速液体クロマトグラフ質量分析計	5,890
F217	マイクロファイバースコープ	880

E100	スパッタリング装置	1,820
E104	真空熱処理装置	790
E200	高精度12bit型ミックスド・シグナル・オシロスコープ	270
E201	2GHz帯デジタル・オシロスコープ	260
E204	分光光度計 (電子材料分光特性評価装置)	580
E209	ネットワーク・アナライザ	590
E210	風量測定器	760
E300	電波暗室	5,030
E301	雑音電界強度測定器	1,810
E302	雑音端子電圧測定器	1,710
E303	雑音電力測定器	1,670
E304	ハンドヘルドスペクトラムアナライザ	240
E305	放射イミュニティ試験器	2,200
E306	伝導イミュニティ試験器	1,300
E307	静電気試験器	300
E308	商用磁界試験器	440
E309	アンテナ計測システム	1,210
E310	オシロスコープ	310
E400	ドローンテスト用ネット	1,220

999	その他の機械器具	100
-----	----------	-----